

ダイオキシン類対策特別措置法に基づく基準等

1. 耐容一日摂取量(TDI)...人が生涯にわたり摂取しても健康に対する有害な影響が現れないと判断される一日体重 1kg 当たりの摂取量。

4pg-TEQ/体重 kg/日 (現在の日本人の平均的な摂取量は1.5pg-TEQ/kg/日程度)

2. 環境基準等

- (1) 大気 年平均値 0.6pg-TEQ/m³以下
- (2) 水質 年平均値 1pg-TEQ/l以下
- (3) 底質 150pg-TEQ/g以下
- (4) 土壌 1000pg-TEQ/g以下

土壌汚染の進行防止等の観点からモニタリングや調査を行う基準としての調査指標値を 250pg-TEQ/g に設定。また、汚染土壌の対策要件は、一般国民の居住・活動の場について 1000pg-TEQ/g を採用。

3. 特定施設及び排出基準

(法施行時における既存施設への排出基準適用は1年間猶予される。)

- (1) 排ガス 特定施設及び排出基準値

(単位:ng-TEQ/m ³ N)			
特定施設種類	施設規模 (焼却能力)	新設施設基準	既設施設基準
廃棄物焼却炉 (火床面積が 0.5 m ² 以上、又は焼却能力が 50 kg/h 以上)	4t/h 以上	0.1	1
	2t/h-4t/h	1	5
	2t/h 未満	5	10
製鋼用電気炉(変圧器の定格容量が 1,000 キロボルトアンペア以上)		0.5	5
焼結炉(銑鉄の製造の用に供するものに限る。)の製造の用に供する焼結炉(原料の処理能力が 1t/h 以上)		0.1	1
亜鉛の回収(製鋼の用に供する電気炉から発生するばいじんであって、集じん機により集められたものからの亜鉛の回収に限る。)の用に供する焙焼炉、焼結炉、溶鋳炉、溶解炉、乾燥炉(原料の処理能力が 0.5t/h 以上)		1	10
アルミニウム合金の製造(原料としてアルミニウムくず(当該アルミニウム合金の製造を行う工場内のアルミニウムの圧延工程において生じたものを除く。)を使用するものに限る。)の用に供する焙焼炉、溶解炉、乾燥炉(焙焼炉、乾燥炉:原料の処理能力が 0.5t/h 以上、溶解炉:容量が 1t以上)		1	5

注:既に大気汚染防止法において新設の指定物質抑制基準が適用されていた廃棄物焼却炉(火格子面積が 2m² 以上、又は焼却能力 200 kg/h 以上)及び製鋼用電気炉については、上表の新設施設の排出基準が適用されている。

(2) 排水 特定施設及び排出基準値

(単位: pg-TEQ/L)	
特定施設種類	排出基準
<ul style="list-style-type: none"> • 硫酸塩パルプ(クラフトパルプ)又は亜硫酸パルプ(サルファイトパルプ)の製造の用に供する塩素又は塩素化合物による漂白施設 • カーバイド法アセチレンの製造の用に供するアセチレン洗浄施設 • 硫酸カリウムの製造の用に供する廃ガス洗浄施設 • アルミナ繊維の製造の用に供する廃ガス洗浄施設 • 担体付き触媒の製造(塩素又は塩素化合物を使用するものに限る。)の用に供する焼成炉から発生するガスを処理する施設のうち廃ガス洗浄施設 • 塩化ビニルモノマーの製造の用に供する二塩化エチレン洗浄施設 • カプロラクタムの製造(塩化ニトロシルを使用するものに限る。)の用に供する硫酸濃縮施設、シクロヘキサン分離施設、廃ガス洗浄施設 • クロロベンゼン又はジクロロベンゼンの製造の用に供する水洗施設、廃ガス洗浄施設 • 4-クロロフタル酸水素ナトリウムの製造の用に供するろ過施設、乾燥施設及び廃ガス洗浄施設 • 2,3-ジクロロ-1,4-ナフトキノンの製造の用に供するろ過施設及び廃ガス洗浄施設 • ジオキサジンバイオレットの製造の用に供するニトロ化誘導体分離施設、還元誘導体分離施設、ニトロ化誘導体洗浄施設、還元誘導体洗浄施設、ジオキサジンバイオレット洗浄施設及び熱風乾燥施設 • アルミニウム又はその合金の製造の用に供する焙焼炉、溶解炉又は乾燥炉から発生するガスを処理する施設のうち廃ガス洗浄施設及び湿式集じん施設 • 亜鉛の回収(製鋼の用に供する電気炉から発生するばいじんであって、集じん機により集められたものからの亜鉛の回収に限る。)の用に供する精製施設、廃ガス洗浄施設及び湿式集じん施設 • 担体付き触媒(使用済みのものに限る。)からの金属の回収(ソーダ灰を添加して焙焼炉で処理する方法及びアルカリにより抽出する方法(焙焼炉で処理しないものに限る。)によるものを除く。)の用に供するろ過施設、精製施設及び廃ガス洗浄施設 • 廃棄物焼却炉(火床面積 0.5m² 以上又は焼却能力 50kg/h 以上)に係る廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設、汚水又は廃液を排出する灰の貯留施設 • 廃 PCB 等又は PCB 処理物の分解施設及び PCB 汚染物又は PCB 処理物の洗浄施設及び分離施設 • フロン類(CFC 及び HCFC)の破壊(プラズマ反応法、廃棄物混焼法、液中燃焼法及び過熱蒸気反応法によるものに限る。)の用に供するプラズマ反応施設、廃ガス洗浄施設及び湿式集じん施設 • 水質基準対象施設から排出される下水を処理する下水道終末処理施設 • 水質基準対象施設を設置する工場又は事業場から排出される水の処理施設 	10

廃棄物の最終処分場の放流水に関する基準は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく維持管理基準を定める命令により 10pg-TEQ/L。